

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 1 月 27 日 (27.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/008233 A1

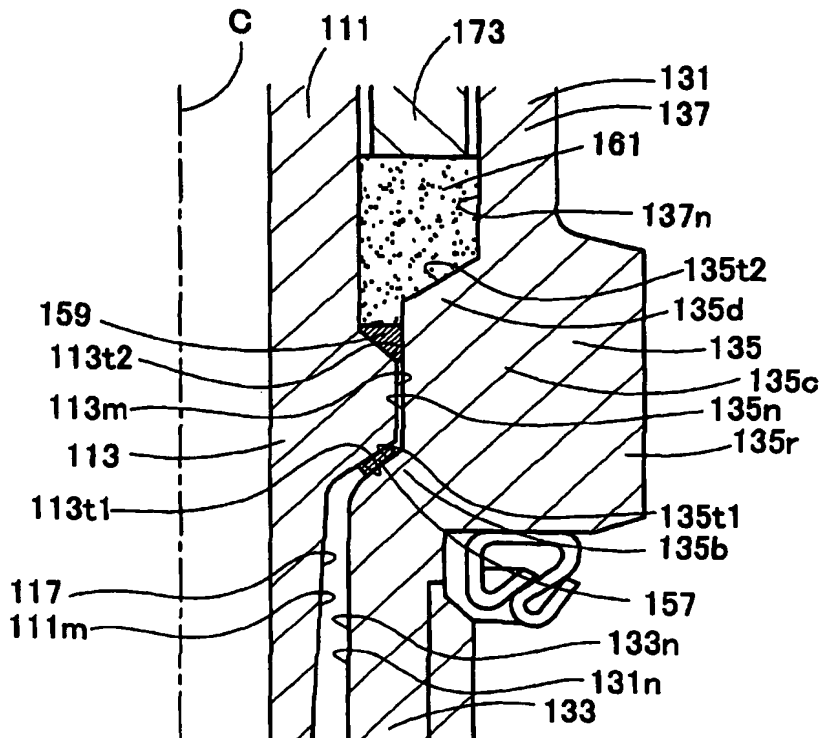
- (51) 国際特許分類: G01N 27/409, 27/12, 27/41, 27/419, 27/416
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009971
- (22) 国際出願日: 2004 年 7 月 13 日 (13.07.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2003-198557 2003 年 7 月 17 日 (17.07.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本特殊陶業株式会社 (NGK SPARK PLUG CO., LTD.) [JP/JP]; 〒4678525 愛知県名古屋市長区瑞穂区高辻町 1 4 番 1 8 号 Aichi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西尾 久治 (NISHIO, Hisaharu) [JP/JP]; 〒4678525 愛知県名古屋

- 豊市瑞穂区高辻町 1 4 番 1 8 号 日本特殊陶業株式会社内 Aichi (JP). 中尾 敬 (NAKAO, Takashi) [JP/JP]; 〒4678525 愛知県名古屋市長区瑞穂区高辻町 1 4 番 1 8 号 日本特殊陶業株式会社内 Aichi (JP). 神前 和裕 (KOUZAKI, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒4678525 愛知県名古屋市長区瑞穂区高辻町 1 4 番 1 8 号 日本特殊陶業株式会社内 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 奥田 誠, 外 (OKUDA, Makoto et al.); 〒4600003 愛知県名古屋市中区錦二丁目 2 番 2 2 号 名古屋センタービル別館 2 階 Aichi (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

[続葉有]

(54) Title: GAS SENSOR AND METHOD OF PRODUCING GAS SENSOR

(54) 発明の名称: ガスセンサ及びガスセンサの製造方法



(57) Abstract: A gas sensor capable of suppressing positional deviation of a member to be held, such as a gas detection element; and a method of producing such gas sensor. A gas sensor (101) comprises a gas detection element (111), a main metal fitting (131), a plate packing (157), and a first packing (159). The base end surface (113t2) of the projection (113) of the gas sensor element (111) cooperates with the central inner peripheral surface (135n) of the main metal fitting (131) to define a clearance (120) having an acute angle. And, disposed in this clearance (120) is a first packing (159) wedge-shaped in cross section which is pressed against the base end surface (113t2) of the projection (113) of the gas sensor element (111) and against the central inner peripheral surface (135n) of the main metal fitting (131).

[続葉有]



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

ガス検出素子などの被保持部材の位置ずれを抑制することができるガスセンサ及びガスセンサの製造方法を提供することを目的とする。ガスセンサ(101)は、ガス検出素子(111)と、主体金具(131)と、板パッキン(157)と、第1パッキン(159)とを備える。ガスセンサ素子(111)の突出部(113)の基端面(113t2)と主体金具(131)の中央内周面(135n)とによって鋭角な間隙(120)が構成されている。そして、この間隙(120)に断面がくさび型の第1パッキン(159)が配設され、この第1パッキン(159)がガスセンサ素子(111)の突出部(113)の基端面(113t2)と主体金具(131)の中央内周面(135n)とにそれぞれ圧接している。